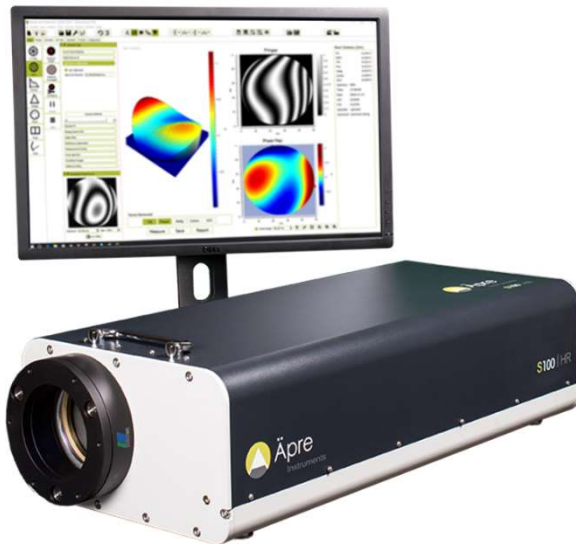


米国 Apré Instruments™ (アプレ社) が製品化したファイゾー型レーザー干渉計
光学部品の製造プロセスを進化させ、現在から未来に渡る計測ニーズに対応
精密加工部品の表面形状、中間空間周波数凹凸成分の測定にも効果を発揮



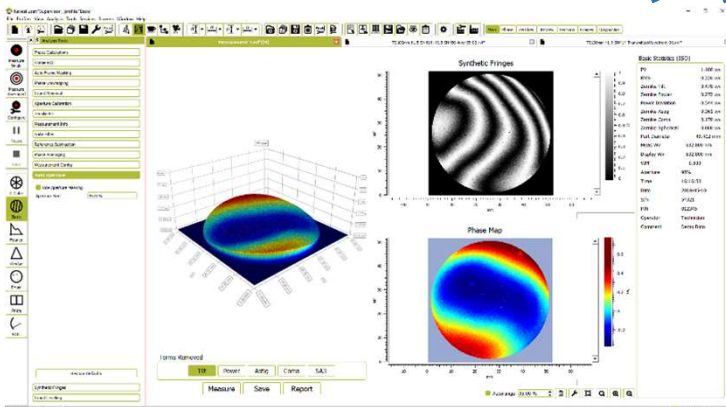
最適な光学性能を追求した干渉計メインフレーム

- 回折限界までのイメージング分解能 : 50 μm (S50 | HR)
- 検出可能な干渉縞(フリンジ)本数の最大化 : 650本 (S | HR)
- リトレース誤差の最小化 : 1/20 波長 (HR で500本の干渉縞)
- 画像歪み(水平方向誤差)の低減 : 0.1% 未満 (全フォーカス範囲)
- 画像湾曲(フォーカス方向誤差)の最小化 : 30 μm 未満 (試料距離2m)

測定対象、測定環境に応じた干渉測定原理が選択可能

- 位相シフト法(PSI) : 基準面を機械的にシフトさせる一般的な手法
- 振動環境に強い位相シフト法(VT PSI) : 振動環境で変動するチルト/ピストンを補正する位相シフト法
- 振動の影響を受けないキャリアフリンジ法 : 干渉縞本数を増やした一枚の画像からの瞬間測定
- SCIオプション 詳細は別紙参照。 : 複数干渉縞の分離測定、最小50 μm 距離までの識別
- 波長変調オプション 専用モデルRW あり : 機械的なシフトが不要なため、基準面や測定口径の自由度が向上

データ取得/解析ソフトウェア **REVEAL™**



- 測定開始からレポート作成まで、10秒以下
- アップグレードにより お手持ちの干渉計に接続が可能
アップグレードの詳細についてはお問い合わせください。
- Windows 64-bit オペレーティングシステム
- 既存データの活用 (.dat形式、.h5 file形式互換)
- 完全なメロロジーパッケージ(パラメータ選択可能)
- カスタムレポートの出力が可能
- 日本語対応表示
- お客様による無償バージョンアップ可能

	S50 HR [SR]	S100 HR [SR]	S150 HR [SR]
システム仕様			
光線口径	51mm (2 inch)	102mm (4 inch)	153mm (6 inch)
光軸高さ	108mm (4.25 inch)	108mm (4.25 inch)	133mm (5.24 inch)
フォーカス範囲	±2,000 mm	±2,000 mm	±4,500 mm
本体寸法(L×W×H)	630×290×180 mm	700×320×250 mm	902×408×239 mm
重量	25 kg	33 kg	50 kg
計測原理	位相シフト法(PSI)、振動に強い位相シフト法(VTPSI)、 振動の影響を受けないキャリアフリンジ法、SCIオプション対応可能		
アライメントシステム	2スポットレティクル(角度範囲2度)		
レーザー光源	波長安定化 SLM 633nm He-Neレーザー		
レーザー波長安定性	<0.0001nm		
可干渉距離	>100m		
光線偏光	円偏光		
光源オプション	SCI光源、波長変調レーザー光源、近赤外波長光源		
カメラ解像度	2044×2044 画素 [1024×1024 画素]		
最小シャッター速度	9μ秒		
デジタイゼーション	12ビット		
コンピュータ&ソフトウェア	高性能PC、Windows® 64-bit OS (ノートPCオプション可能) 及びREVEALソフトウェア Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です		
本体固定方向	水平、または垂直		
対応アクセサリ	業界標準パヨネットマウント		
性能仕様			
画像解像度(回折限界)	50μm [100μm]	100μm [200μm]	150μm [300μm]
画像歪み(水平方向)	<0.1% (全フォーカス範囲)		
画像湾曲(像面湾曲)	<30μm (試料距離2mにて)		
フリンジ解像度	650[325]本/口径(PSI&VTPSI)、500[250]本/口径(キャリアフリンジ)		
リトレース誤差(1)	<1/20波長 干渉縞本数500[250]以下の場合		
RMS単純再現性(2)	<0.5nm RMS2、平均化なし		
RMS波面再現性(3)	<0.5nm RMS2、平均化なし		
試料反射率	0.5%~40%(直接測定)、41%以上(減衰フィルターまたはコーティング対応)		
環境仕様			
温度	15~30		
温度変化	<1.0/15分		
湿度	5%~95%、結露がないこと		
振動対策	防振台の使用を推奨		

(1) リトレース誤差: ヌルフリンジ(干渉縞0本)の測定データと、最大フリンジ数の測定データの差分として定義。Zemke36項の成分での減算。

(2) RMS単純再現性: 短い平面キャピティでの36回の連続測定におけるRMS値の2として定義。各測定は平均化なし。

(3) RMS波面再現性: 短い平面キャピティでの36回の連続測定における平均データを基準とした各データの差分のRMS値+2として定義。各測定は平均化なし。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

キヤノンロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。記載の内容は2018年5月23日時点の情報から作成しております。弊社の都合により仕様や内容を予告なく変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。サービス役務につきましては、別途消費税を申し受けますのでご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
産業機器事業部 計測分析機器部 計測機器課
TEL. 03-3740-3334

●お求めは信用のある当社で

サイバネットシステム株式会社
CAE事業本部オプティカル事業部
TEL: 03-5297-3405
E-MAIL: optsales@cybernet.co.jp
WEB: <https://www.cybernet.co.jp/optical/products/measurement/>